

表面多探针分析系统



型号	Multi Analysis Probes System
仪器指标	超高真空: $< 3 \times 10^{-10}$ mbar - 扫描探针显微镜 STM/AFM - 光电子能谱仪 XPS/UPS - 低能电子衍射 LEED - 程序升温脱附 TPD
分析能力	表面结构分析, 表面元素定量分析, 脱附物种定量分析;
仪器特色	该设备配备了 6 种表面分析手段, 可在超高真空中进行分析表征($< 10^{-8}$ mbar); XPS 能量分辨率 0.6 eV, STM 和 AFM 分辨率可到 0.1 nm, 可得到原子分辨率的表面结构图象